

【11】證書號數：M497780

【45】公告日：中華民國 104 (2015) 年 03 月 21 日

【51】Int. Cl.： G01N11/00 (2006.01)

新型

全 5 頁

【54】名稱：液性流性限度試驗儀

【21】申請案號： 103219531 【22】申請日：中華民國 103 (2014) 年 11 月 04 日

【72】新型創作人：沈茂松 (TW)

【71】申請人： 國立高雄應用科技大學
高雄市三民區建工路 415 號

【74】代理人： 桂齊恆；林景郁

[57]申請專利範圍

1. 一種液性流性限度試驗儀，其包含：一底座，其具有一頂面；一液性量測部，其固設於該底座之頂面；複數擋止部，其間隔形成於該底座之頂面，各擋止部間互相平行；一板體，其具有相對之二邊，且該板體之其中一邊選擇性地靠抵於該液性量測部，且該板體之另一邊選擇性地置於該等擋止部之其中一者。
2. 依據請求項 1 所述之液性流性限度試驗儀，該液性量測部包含一基台、一量測件、一推升件與一旋動件；該基台具有一頂板、兩側壁與一空間，該頂板之兩側分別與對應之側壁的一邊相連接，該等側壁係相對，各側壁相對於頂板之一邊則連接固定於該底座之頂面，且各側壁上穿設有一穿孔，該空間係形成於該頂板、該等側壁與該底座之間；該量測件裝設於該基台上並包含一固定板、一推升塊與一圓盤，該固定板包含一固定端與一樞接端，該固定板之固定端裝設固定於該基台之頂板相對於該空間的一面，該推升塊則樞接於該固定板之樞接端並位於該底座之上方，且該推升塊之高度低於該基台之頂板，該圓盤連接固定於該推升塊並位於該底座之上方，且該圓盤之高度低於該基台之頂板，該圓盤包含相對之一凹面與一凸面，該圓盤之凸面靠近圓盤圓周處係與該推升塊相連接固定，該圓盤之凸面選擇性地敲擊該底座之頂面；該推升件位於該空間中並具穿設有一開孔，且該推升件選擇性地推頂該推升塊，使得該圓盤朝遠離該底座之頂面的方向抬升；該旋動件穿設於該基台並包含一樞轉段、一連接段與一旋轉段，該樞轉段同時穿過該推升件之開孔與該等側壁之穿孔，該樞轉段與該旋轉段分別由該連接段之相反二側及相對二端突伸，且該連接段與該樞轉段、該旋轉段呈垂直；該板體之其中一邊選擇性地靠抵於該液性量測部之推升塊；該等擋止部係與該基台平行。
3. 依據請求項 1 或 2 項所述之液性流性限度試驗儀，該底座更包含一側面，該側面與該頂面相連接，該側面上標示有複數角度值，各角度值係對應於相對之擋止部。

圖式簡單說明

圖 1 為本創作之一較佳實施例之外觀圖。

圖 2 為本創作之一較佳實施例測試流性限度時之剖面圖。

圖 3 為本創作之一較佳實施例之分解圖。

圖 4 為本創作之一較佳實施例測試液性限度時之一外觀圖。

圖 5 為本創作之一較佳實施例測試液性限度時之一剖面圖。

圖 6 為本創作之一較佳實施例測試液性限度時之另一剖面圖。

圖 7 為本創作之一較佳實施例測試液性限度時之另一外觀圖。

(2)

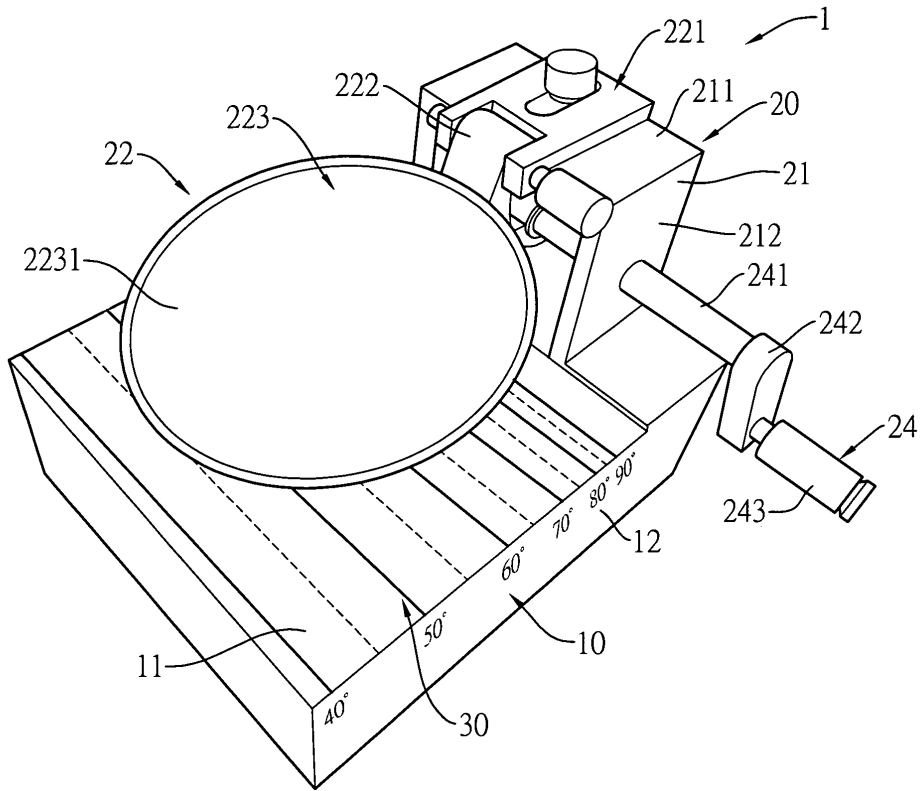


圖 1

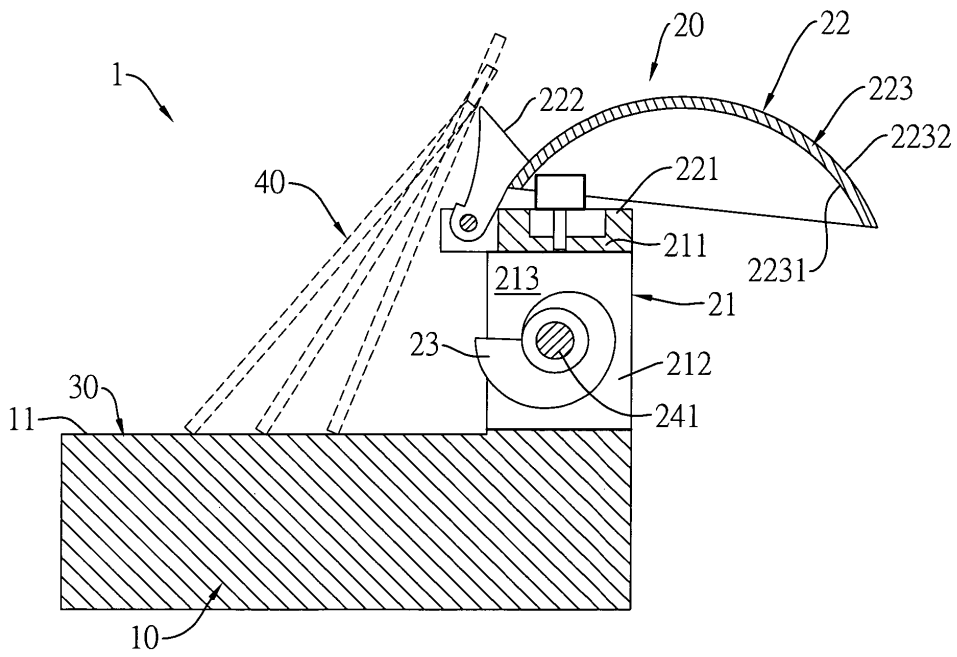
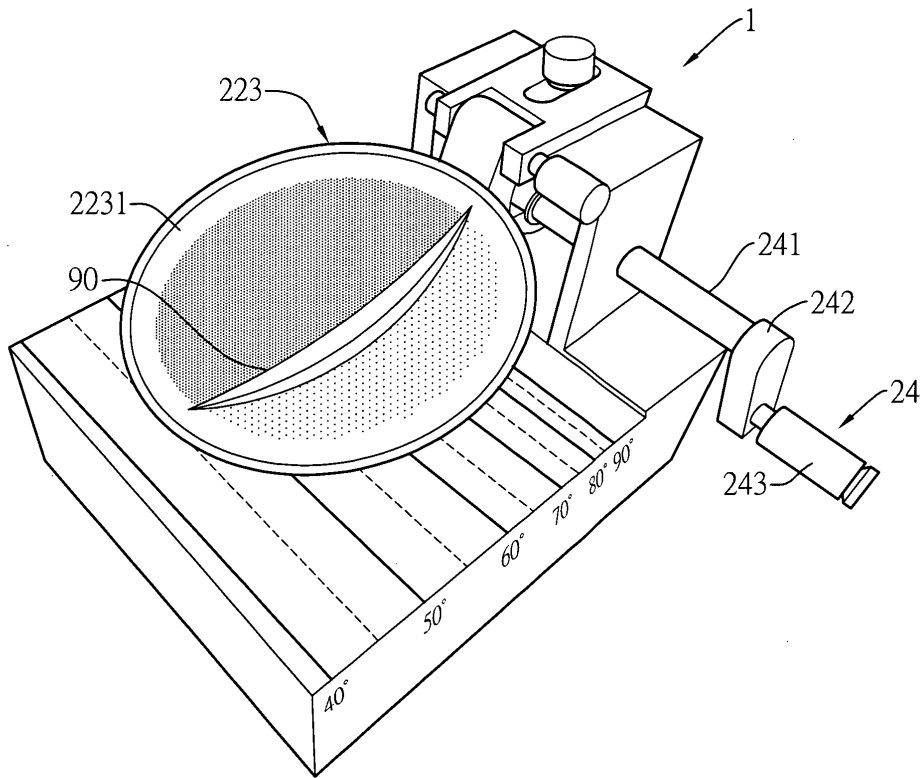
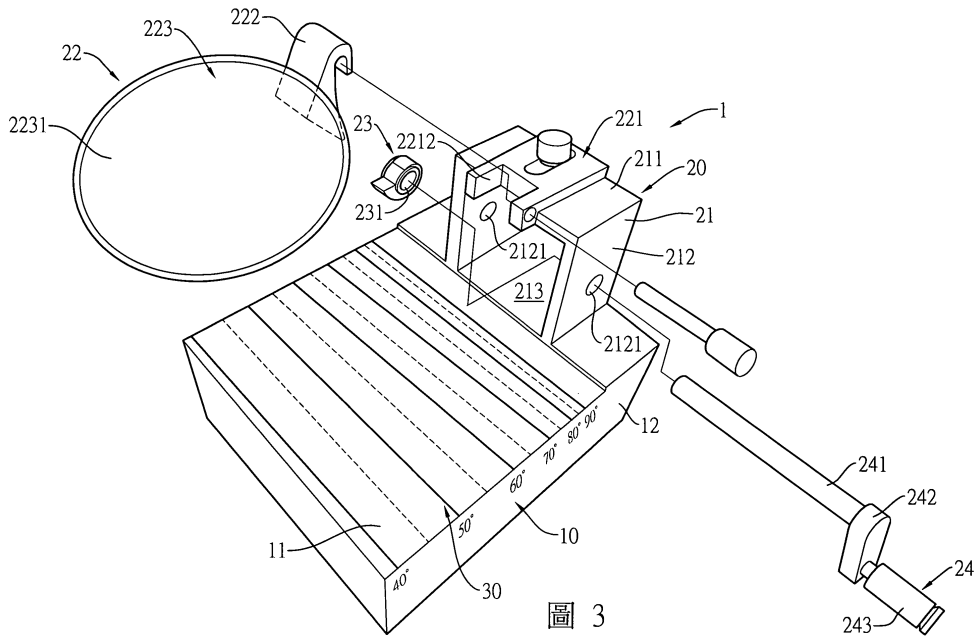


圖 2

(3)



(4)

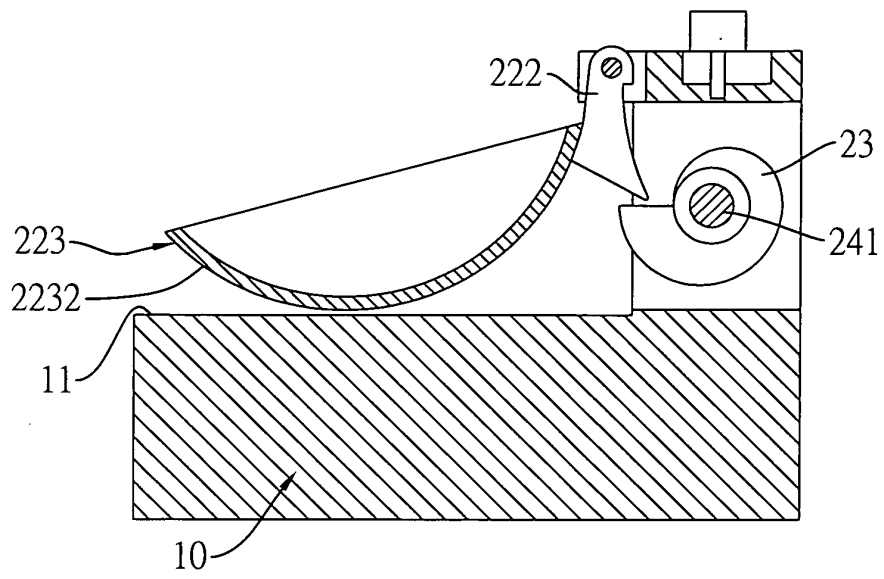


圖 5

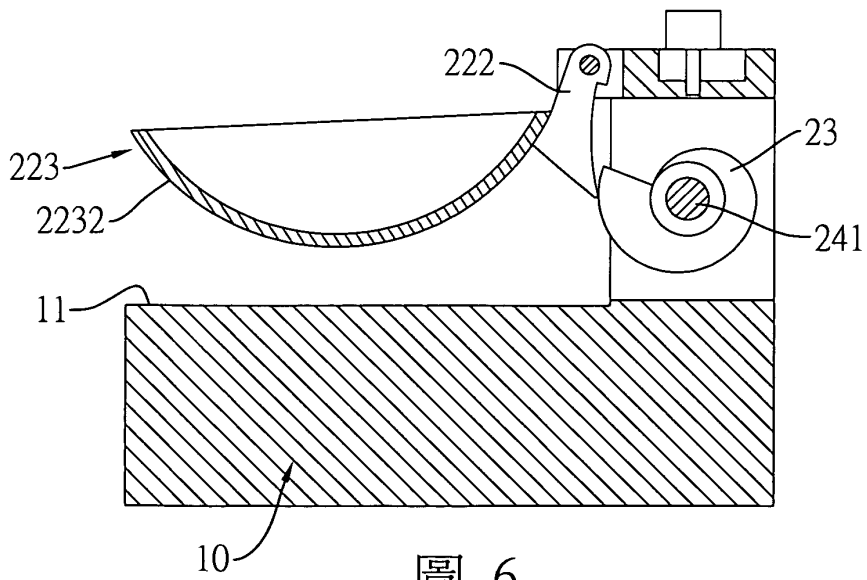


圖 6

(5)

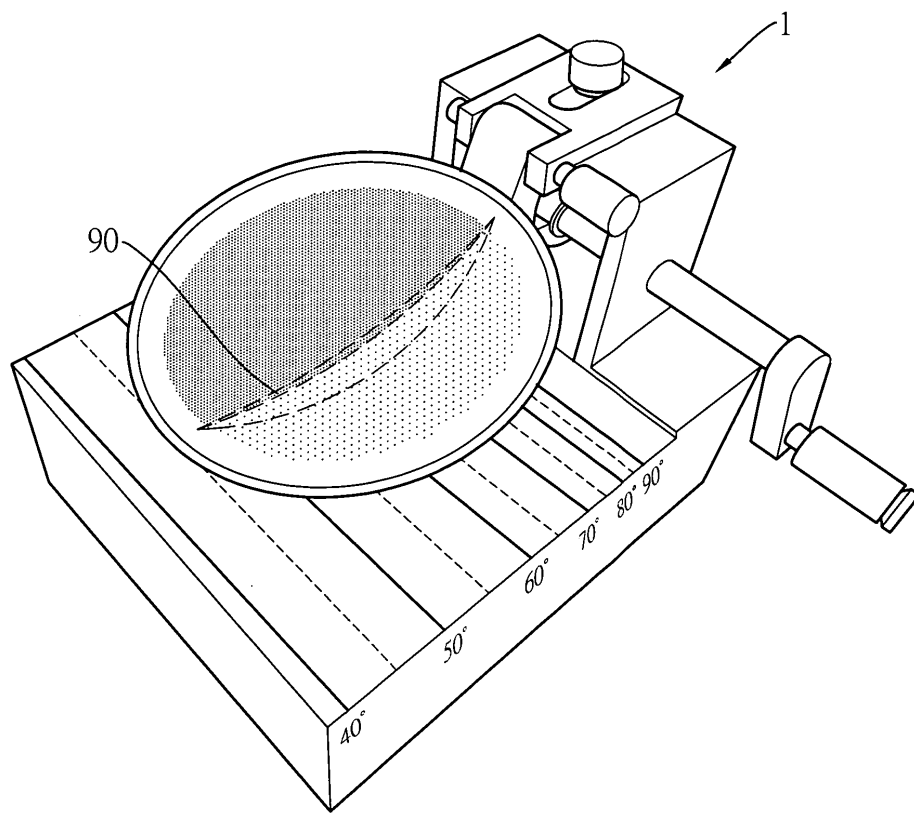


圖 7